

"超高真空走査プローブ顕微鏡技術の発展"

実用顕微評価技術セミナー2021

シエンタ オミクロン株式会社

超高真空走査プローブ顕微鏡(Scanning Probe Microscopy: 以下 SPM)技術は、1982 年 G. Binnig と H. Rohrer によって開発された走査型トンネル顕微鏡に端を発し、物質の表面状態をナノまたは原子スケールで可視化する為の有力な顕微鏡技術として研究開発がおこなわれて来た。

現在、SPM は試料の表面形状を観測するだけでなく、物性を評価する機能の付与のニーズも高まり、新たな手法が展開されている。各装置メーカーも測定対象に応じたユニークな機能開発を勢力的に進めている。

本セミナーでは弊社の超高真空 SPM オプション機能と新たに超高真空 SPM に加わった製品を紹介し、超高真空走査プローブ技術の今後の展望について紹介する。